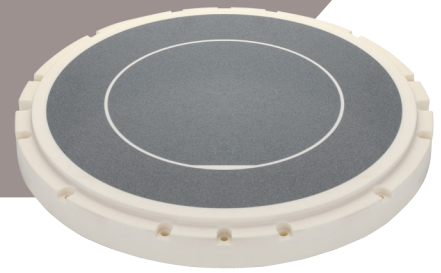


Vacuum Chuck Table



Ceramic porous vacuum chuck table

대표 사용분야

반도체

Back lap, Dicing, Laser marking process 공정

디스플레이

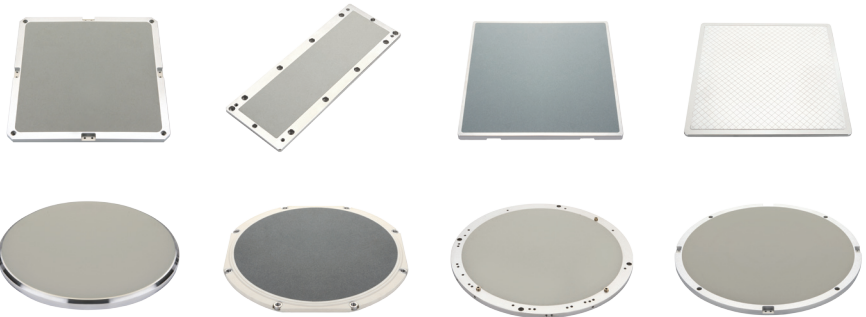
OLED process 공정

PCB

PCB Drilling Process 공정

RPS 척테이블 장점

- ▶ 우수한 평탄도 및 안정성
- ▶ 대전방지용 척테이블 및 다양한 형상의 척테이블 제작



제품 재질

Base Material	SUS	Al	Ceramic
Porous Material	Al ₂ O ₃		

기본 사양

Size	4 Inch	6 Inch	8 Inch	12 Inch
Flatness	3 μ m 이하	3 μ m 이하	4 μ m 이하	5 μ m 이하

*상기 사양 외 고객 요청에 따른 customizing 가능